




특허청  
하나된 열정  
하나된 대한민국

# 보도자료

www.kipo.go.kr

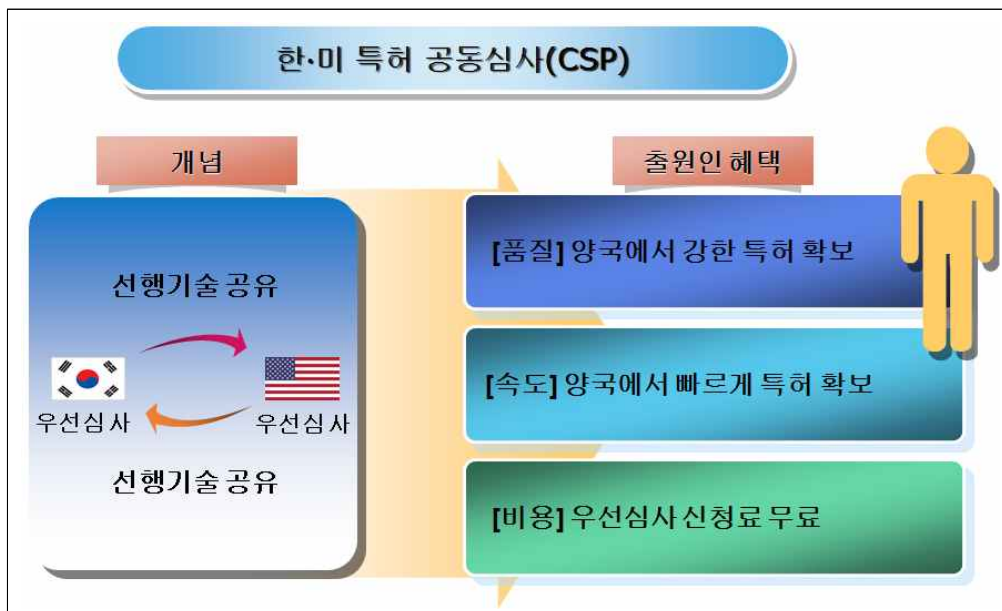
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

문 의	특허심사기획국	과 장 강흠정	042-481-8321
	특허심사제도과	사무관 한주철	042-481-5400
		<p style="text-align: center;">배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.</p>	

## 미국특허를 손쉽게 확보하려면...

### - 한·미 특허 공동심사(CSP) 신청요건 완화 및 절차 간소화 -

- 한·미 특허청은 2017년 11월 1일부터 특허 공동심사(CSP, Collaborative Search Program) 2차 시범사업을 시행한다.
- CSP는 우리나라와 미국에 동일한 발명이 출원된 경우 특허여부를 판단하는데 필요한 선행기술 정보를 양국 심사관들이 공유하고, 다른 출원 건보다 빠르게 심사해 주는 제도이다.
- 특히 미국 특허청에서 약 5백만원의 우선심사 신청료를 면제하여, 국내 기업의 미국특허 취득 시간과 비용이 크게 줄어든다.



- 1차 시범사업은 2017년 8월 31일까지 2년 간 진행되었고, 이 기간 동안 국내외 기업으로부터 112건(국내 77건, 국외 35건)이 신청되었다.
- 심사 처리기간은 평균 7.5개월로 일반심사 건 대비 3.5개월 단축되었고, 특허 등록률은 84.4%로 일반심사 건 대비 25.2%p가 높았다. 양국 심사결과(특허등록 또는 거절)는 85.3%가 일치하였다.
  - \* 2017년 10월 31일 기준으로 특허처리기간, 특허등록률, 심사결과 일치률 산출
- 한편, 1차 시범사업 동안 국내외 출원인으로부터 심사처리 기간 단축과 심사품질 향상에 기여한다는 호평을 받았음에도 불구하고, 신청요건이 엄격하고 일부 절차가 불합리하다는 의견이 있었다.
- 이번 2차 시범사업에서는 출원인의 불편 사항을 개선하였다.
  - 첫째, 종전에는 CSP 신청 당시 양국 출원서에 기재된 모든 발명이 동일해야 했으나(전체 청구항 동일), 대표 발명만이 동일하도록(독립 청구항만 동일) 신청요건을 완화하였다.
  - 둘째, 미국만의 독특한 제도\*로 인해, 양국이 CSP를 통해 공유한 선행기술 정보일지라도 출원인이 이를 미국에 중복하여 제출해야 하는 부담이 있었으나, 절차를 간소화하여 이를 해소하였다.
    - \* 미국 선행기술 제출 제도(Information Disclosure Statement): 심사관의 특허요건 판단에 중요한 정보를 출원인이 제공하는 의무로 위반 시 특허권 행사 제한
- 향후 특허청은 국내 기업이 다른 국가에서도 편리하게 해외특허를 확보할 수 있도록, 중국 등 주요국과 CSP를 확대할 계획이다.
  - \* CSP 문의: 특허청 홈페이지 (www.kipo.go.kr), 특허심사제도과(042-481-5400)

※ 붙임. 한·미 특허 공동심사(CSP) 개요



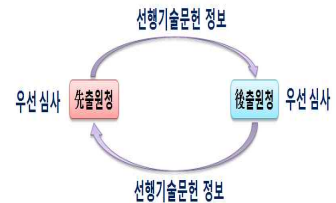
보도자료와 관련해 자세한 내용을 원하시면 특허심사기획국 특허심사제도과 한주철 사무관(☎ 042-481-5400)에게 연락 바랍니다.

※ 2차 시범사업 시행기간: 2017년 11월1일~2020년 10월 31일(3년)

**■ CSP 개념**

두 나라에 동일 발명을 출원한 경우(출원인), 선행기술 정보를 공유하고 빠르게 심사(특허청)하여 심사결과 정확성·일관성\*을 높이는 제도

\* 양국 심사결과 동일(예: 양국 등록 또는 거절)



**■ CSP 기대효과**

- ▶ 선행기술 정보 공유로, 심사결과 정확성 및 일관성 향상
- ▶ 우선심사 수행\*으로, 두 나라에서 조기에 특허취득 가능
  - \* 양국에서 우선심사 신청료(미국 4천불, 한국 20만원) 감면
- ▶ 상대국 선행기술 정보 활용으로, 특허청의 심사업무 중복 감소

**■ 개선사항**

- ▶ [신청요건 완화] ① 양국 전체 청구항 동일 요건을 독립항만 동일로 변경, ② 양국 출원인 동일 삭제, ③ 발명의 단일성 만족 삭제
- ▶ [절차 개선] 1차 시범사업의 개선사항(삭제 1,2 관련) 반영
  - (삭제 1) 출원인이 미국에 양국 선행기술에 대한 IDS\* 미제출
    - \* 미국 선행기술문헌 제출제도(Information Disclosure Statement): 특허요건 판단에 중요한 정보를 출원인이 제공하는 의무로 위반시 특허권 행사 제한
  - (삭제 2) 출원인의 불필요한 면담 절차 해소

